# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2001-297730

(43)Date of publication of application: 26.10.2001

(51)Int.CI.

H01J 49/42 GO1N 27/62

(21)Application number: 2000-

(71)Applicant : HITACHI LTD

118489

(22)Date of filing:

14.04.2000 (72)Inventor: OKUMURA AKIHIKO

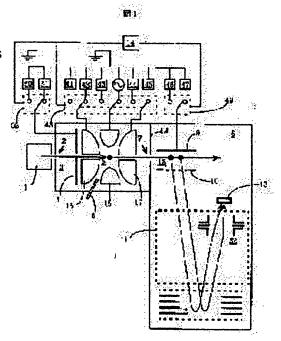
HIRABAYASHI TSUDOI

# (54) MASS SPECTROMETER DEVICE

# (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a highsensitivity, high-resolution flight-time type mass spectrometer device.

SOLUTION: After ion is accumulated in a quadruple ion trap 5 into which helium gas is guided in through a gas tube 6, ion is injected and transferred to high-vacuum part, and electric field is accelerated at right angle to ion traveling direction at an accelerator electrode 9 to perform flight time spectrometry. With this, a tiny amount of high molecular weight sample such as genes or proteins can be separated and analyzed at high speed and accuracy.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-297730 (P2001 - 297730A)

(43)公開日 平成13年10月26日(2001.10.26)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

H01J 49/42 G01N 27/62 H01J 49/42

5 C O 3 8

G 0 1 N 27/62

K

L

審査請求 未請求 請求項の数9 〇L (全 5 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願2000-118489(P2000-118489)

平成12年4月14日(2000.4.14)

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72)発明者 奥村 昭彦

東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目280番地

株式会社日立製作所中央研究所内

(72) 発明者 平林 集

東京都国分寺市東恋ケ窪一丁目280番地

株式会社日立製作所中央研究所内

(74)代理人 100075096

弁理士 作田 康夫

Fターム(参考) 50038 FF07 FF10 JJ06 JJ07 JJ09

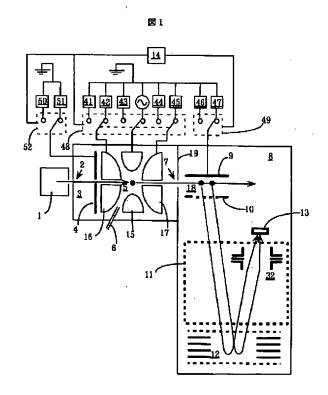
# (54) 【発明の名称】 質量分析装置

# (57)【要約】

【課題】高感度で高分解能な飛行時間型質量分析装置を 提供する。

【解決手段】ガス管6を通してヘリウムガスが導入され ている四重極イオントラップ5にイオンを蓄積した後、 イオンを射出して高真空部8に移送し、加速電極9にお いてイオンの進行方向に対して直角に電場加速して飛行 時間質量分析を行う。

【効果】遺伝子や蛋白など微量の高分子量試料を高速か つ高精度に分離分析できる。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】四重極イオントラップと四重極イオントラップからイオンを射出するイオン射出手段と射出されたイオンをその進行方向に直交する方向に加速する加速部と加速されたイオンの飛行時間を測定する飛行時間測定部とを備えることを特徴とする質量分析装置。

【請求項2】四重極イオントラップと四重極イオントラップからイオンを射出するイオン射出手段と射出されたイオンを加速する加速部と加速されたイオンの飛行時間を測定する飛行時間測定部とを備える質量分析装置であって、四重極イオントラップ射出されたイオンの進行方向と加速部の加速方向とが90度よりも大きな角度を成すことを特長とする質量分析装置。

【請求項3】前記イオン射出手段が、四重極イオントラップへの交流電圧の印加を停止した後に直流電圧を印加するものであることを特徴とする請求項1または2に記載の質量分析装置。

【請求項4】前記四重極イオントラップから射出されたイオンを、前記加速部により加速されるまでの間にイオンの進行方向に再加速するための再加速部を備えることを特徴とする請求項1~3に記載の質量分析装置。

【請求項5】前記加速部により加速されたイオンをイオンの進行方向に再加速するための再加速部を備えることを特徴とする請求項1~4に記載の質量分析装置。

【請求項6】リフレクトロンを備えることを特徴とする 請求項1~5に記載の質量分析装置。

【請求項7】前記四重極イオントラップが平板電極で構成されることを特徴とする請求項1~6に記載の質量分析装置。

【請求項8】前記加速部の直前に静電レンズを備えることを特徴とする請求項1~7に記載の質量分析装置。

【請求項9】前記加速部の直前にスリットを備えることを特徴とする請求項1~8に記載の質量分析装置。

# 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、飛行時間型質量分析装置に関する。

## [0002]

【従来の技術】公知例1 (U. S. Patent 5689111) には、イオンガイドを通して連続イオン流を生成し、その一部分をイオン流に対して直角方向に電場加速して飛行時間測定する飛行時間型質量分析装置が開示されている。この装置では、飛行時間測定中にはイオンガイドにイオンをトラップしておくことによりイオンの利用効率を向上して感度が向上されている。公知例2 (B. M. Chien, S. M. Michael and D. M. Lubman, Rapid Commun. Mass Spectrom. 7(1993)837.) には、四重極イオントラップと飛行時間型質量分析計とを結合した質量分析装置が開示されている。断続的または連続的に生成されたイオンをイオントラップに捕捉・蓄積した後に飛行時間型質量分析を行な

う。イオントラップにイオンを蓄積することができるため高感度な分析が可能である。

# [0003]

【発明が解決しようとする課題】公知例1の質量分析装 置では、イオン流の方向に関するイオンの空間的・エネ ルギー的拡がりが大きく、トラップしたイオンの一部し か検出できない。これに対して公知例2の質量分析装置 では、トラップしたイオンの殆どすべてを検出すること ができる。しかしながらイオントラップにはイオンの捕 捉効率を向上するため、およびイオンの空間的・エネル ギー的拡がりを低減して質量分解能を向上する目的で、 イオントラップ内部にダンピング用のヘリウムガスが導 入される。しかしながら、イオントラップからイオンを 射出する際には、ヘリウムガスはイオンの進行を妨害し て逆に分解能の低下を招く。そのため、遺伝子や蛋白な どの高分子量試料の分析においては十分な分解能が得ら れなかった。本発明の目的は、従来技術の問題を解消し た高感度かつ高分解能な質量分析装置を提供することに ある。

## [0004]

【課題を解決するための手段】四重極イオントラップに イオンを蓄積した後にイオンを射出し、高真空部に達し てから射出方向に直交する加速電場を形成して飛行時間 測定する。

# [0005]

【発明の実施の形態】図1に、本発明の一実施例である 質量分析装置の構成図を示す。イオン源1において連続 的または断続的に生成されたイオンは、サンプリングオ リフィス2から真空装置の低真空部3に導入され、ゲー ト電極4を通過して四重極イオントラップ5に入射す る。ダンピング用のヘリウムガスはガス管6より四重極 イオントラップ5内部に導入される。四重極イオントラ ップ5から射出されたイオンは、ピンホール7を通過し て高真空部8に入射し、加速電極9により電場加速され て斜め前方に向かって飛行し、電極10と電極11との 間でさらに加速され、電極11で囲まれた無電場空間を 飛行して、リフレクトロン12に入射する。電極10は イオンを通過させるためにメッシュ状であるが、外周部 は板状であり、全体の外形は加速電極9とほぼ等しい。 そのため加速電極9に加速電圧を印加してから加速部1 8に進入したイオンは直ちに加速されて電極10の外周 部に衝突して検出器には到達しない。リフレクトロン1 2内でイオンは反転し再び無電場空間を飛行し、静電レ ンズ32を通過して検出器13に到達する。二段加速と リフレクトロンを用いることにより、加速部18内での イオンの空間的拡がり(加速方向に関する)による時間 拡がりを検出面の位置において収束させることができる ため、高分解能が得られる。リフレクトロンの使用によ り装置サイズが小さくなる効果もある。静電レンズ32 を用いてイオン軌道を収束させることにより小型の検出

器が使用できる。制御部14は、スイッチ48、49および52を切り替えることにより、ゲート電極4、リング電極15、エンドキャップ電極16および17、加速電極9への印加電圧を制御する。

【0006】図2に、本発明の一実施例である質量分析 装置における電圧制御シーケンスを示す。ゲート電極4 にはイオンが通過し得る電圧Vinとイオンが通過し得な い電圧Voutとをそれぞれ時間T1およびT2だけ交互 に繰り返して印加する。ゲート電極4に電圧Vinが印加 されている間、リング電極15には高周波電圧が印加さ れる。ゲート電極の電圧がVoutに切り替わった後、リ ング電極15には適当な直流電圧Vringが一定時間T3 (<T2)だけ印加される。リング電極15に電圧Vri ngが印加されるのと同時にエンドキャップ電極16およ び17に適当な直流電圧Vendl6およびVendl7が一定時 間T3だけ印加される。一定時間T3が過ぎてからゲー ト電極4の電圧がVinに切り替わる。電圧Vring、Ven d16およびVend17は、正イオン測定の場合にはVend16 > Vring> Vend17、負イオン測定の場合には Vend16< Vring < Vend17となるような値とする。リング電極 1 5に高周波電場を印加したままで電圧 Vring、Vendl 6、Vend17を印加してもイオンの射出は可能であるが、 射出されたイオンの空間拡がりが大きくなり感度が低下 する。リング電極15に電圧Vringが印加されてから時 間T4を経た後に、加速電極9に一定時間T5だけ加速 電圧Vaccを印加する。ここでT4+T5<T2+T3 である。加速電極9にはVaccを印加していない間は電 圧V0が印加されている。電圧V0は電極10に常時印加 されている電圧と同一である。

【0007】図3に、本発明の一実施例である質量分析計の別の構成図を示す。四重極イオントラップ5として平板型の四重極を用いる。平板型四重極は4枚の平行平板電極21~24で構成され、両端の2枚はエンドキャップ電極21および24、中間の2枚はリング電極22 および23である。2枚のリング電極22および23には同一の高周波電圧を印加する。平板型四重極イオントラップでは均一な加速電場を形成できるため、(1)イオンビームの拡がりが小さい、(2)二段加速による空間収束位置の制御が容易であり、(3)収束効果も良好である利点がある。二段加速による空間収束位置を検出位置またはその近傍に設定することにより、検出器13の検出面内でのイオンの拡がりが低減され感度が向上される

【0008】図4に、本発明の一実施例である質量分析 装置のさらに別の構成図を示す。ピンホール7を通過し たイオンは、静電レンズ30およびスリット31を通過 して加速部18に到達する。静電レンズを用いることによりイオンの空間およびエネルギー拡がりを抑えることができるため、分解能が向上される。スリットを用いることによりイオンの空間的拡がりを小さくすることにより分解能が向上される。

【0009】図5に、本発明の一実施例である質量分析計のさらに別の構成図を示す。四重極イオントラップ5から出射したイオンの進行方向に対して加速部18の加速電場の方向は90度より大きい。この場合、m/zの小さいイオンほど加速距離が長いため獲得する運動エネルギーが大きい。一方、加速方向に垂直な方向の運動エネルギーはm/zに依らず一定である。そのため適当な条件を設定することにより、検出器の検出面におけるイオンの入射領域を狭めることができる。そのため小型の検出器を利用できる。あるいは検出器の大きさが一定の場合には測定可能な質量範囲を広げることができる。検出器直前に静電レンズを配置してイオン軌道を収束させる方法では分解能が低下しない。

### [0010]

【発明の効果】イオンを高真空部に移動させてから電場加速して飛行時間測定することにより、ダンピング用のヘリウムガスなどとの衝突頻度が低減し分解能が向上した。

## 【図面の簡単な説明】・

【図1】本発明の一実施例である質量分析装置の構成図。

【図2】本発明の一実施例である質量分析装置における 電圧制御シーケンス。

【図3】本発明の一実施例である質量分析計の別の構成 図.

【図4】本発明の一実施例である質量分析計のさらに別 の構成図。

【図5】本発明の一実施例である質量分析計のさらにま た別の構成図。

### 【符号の説明】

1 · · · イオン源、2 · · · サンプリングオリフィス、3 · · · 低真空部、4 · · · ゲート電極、5 · · · 四重極イオントラップ、6 · · · ガス管、7 · · · ピンホール、8 · · · 高真空部、9 · · · 加速電極、10、11 · · · 電極、12 · · · リフレクトロン、13 · · · 検出器、14 · · · 制御部、15 リング電極、16、17 · · · エンドキャップ電極、18 · · · 加速部、19 · · · 隔壁、21、24 · · · エンドキャップ電極、22、23 · · · リング電極、30、32 · · · 静電レンズ、31 · · · スリット、41~47、50、51、53 · · · 直流電源、48、49、52 · · · スイッチ。

【図2】 【図1】 **2**1 ⊠ 2 14 Vend16 Vend17 【図4】 网4 【図3】 図3

【図5】

